# 4国海光

第16卷 第3期

# 用稳光程干涉仪拍频检测小位移

## 汤俊雄 李爱国 (北京大学无线电系)

Measurement of small displacement by an interferometer of stable optical path difference and hetrodyne detection

#### Tang Junxiong, Li Aiguo

(Department of Radio and Electronics, Beijing University, Beijing)

提要:本文报告了一个检测低频小位移的方案,以塞曼双频激光器为光源,用迈 克尔逊干涉仪进行检测。为克服低频噪声影响,采用伺服环路锁定干涉仪光程差,且 用拍频技术检测信号,对于3.3kHz的信号,检测最小位移达0.005nm。

关键词: 拍频,稳光程

## 一、引言

检测微小振动位移一般采用光学零拍和 光学拍频检测法。用迈克尔逊干涉仪实现零 拍检测时,采用的是单频激光器,两臂光束具 有相同频率。一面镜子被电信号驱动,其小 位移信息通过检测干涉光强而获得,但低频 噪声使低频小位移的检测较为困难。拍频检 测法采用双频激光器,双频激光产生拍频信 号,有意义的小位移信息被载(拍)频移到较 高的频率范围内处理。这种拍频检测技术避 开了某些低频噪声源的干扰,因而优于零拍 检测法。文献[1]使用拍频检测技术,对频率 为2kHz的正弦信号进行了小位移检测,其 检测分辨率达到了012nm。

环境噪声是诸多噪声中的主要因素,实 验中观测到,由于环境噪声的干扰,干涉仪程 长的抖动达几nm,这无疑会妨碍微小位移信 号的检测。为此采用了伺服回路锁定干涉仪 程长,大大提高了其稳定度,并能有效地选择 工作点,从而使检测数据的准确度大为提高。 本方案把稳光程技术和拍频检测结合起来, 使检测分辨率得到较大提高。

### 二、实验原理与特点

#### 2.1. 实验装置与工作原理

用纵向塞曼激光器作光源,其左、右旋圆 偏振光通过偏振片后能方便地产生拍频信 号。实验布局如图1所示。激光束到达分束 器 M 时,光场具有下面的形式:

 $U(t) \propto (e^{j2\pi f_1 t} + e^{i2\pi f_2 t})$ 

式中 $f_1$ 、 $f_2$ 分别为双频激光束的频率。 经过 M 分束及 $M_1$ ,  $M_2$ 反射镜后, U(t)分解为  $U_1(t)$ ,  $U_2(t)$ ,  $U_1(t) = A_{10}e^{i\phi_1}U(t)$ 

收稿日期:1987年10月5日。

<sup>•</sup> 属国家自然科学基金资助项目。



#### 图1 小位移检测实验布局

 1—压电陶瓷 2—镜片 3—高压源 4—信号发生器
 5—分束器 6—偏振片 7—塞曼激光器 8—锁相放 大器 9—示波器 10—光接收器 11—低通滤波器
 12—工作点监测 13—差分放大器 14—参考电平 15—带阻滤波器 16—积分器 17—高压放大器

#### $\overline{U}_{2}(t) = A_{20} e^{i\phi_{2}} \overline{U}(t)_{0}$

 $\phi_1, \phi_2$ 分别是经过镜子反射后所引起的位相 变化。双光束干涉,探测器接收干涉光强  $I(t) \propto |U_1(t) + U_2(t)|^2$ 。有:

$$I(t) = I_0 [1 + \gamma \cos(\phi_1 - \phi_2)] + I_0 [1 + \gamma \cos(\phi_1 - \phi_2)] \cos 2\pi f_0 t$$
(1)

式中γ为相干迭加两光束振幅不等所引起的 反衬度因子; fo= |f1-f2|,为双频激光束的差 频,即拍频频率。(1)式中第一项为零拍项, 等效于同频激光束的干涉项; 第二项是不同 频率激光束的拍频项。可以看出,拍频项的振 輻和零拍项振幅相同。它与干涉仪两臂的相 位差 $(\phi_1 - \phi_2)$ 有关,即包含着对镜子加调制 后的小位移信息。利用它可得到小位移检测 结果。为了避开低频噪声的影响,在检测位 移信息时不采用(1)式中的第一项,而采用第 二项。用锁相放大器振幅解调技术取出第二 项的振幅值,获得小位移信息,这就是拍频检 测法。另外,为了稳定干涉仪程长,我们从光 强信号里用低通滤波器检测出(1)式第一项, 利用它锁定干涉仪程长。这样有利于抑制环 境噪声、避开低频噪声源,提高检测分辨率。

#### 2.2 锁定干涉仪程长与选择工作点

和激光外腔稳频技术<sup>123</sup>不同,我们把干 步光强-光程差曲线作为鉴别程长曲线,把干 涉仪光程差锁在干涉曲线一侧之中点(工作 点),干涉仪光程差偏离锁定点会产生误差信 号,通过伺服环路中的压电陶瓷调节镜片位 置,使光程差值复原,压电陶瓷镜片起调程长 作用。

图 2 示出干涉光强随光程差的小振动而 变化的情况,图中 Q 为工作点。由于 Q 选在 干涉强度曲线一侧之中点,即斜率最大处,变 化光程差可得到最大的光强信号。



图2 干涉仪光程差在工作点 Q 的小振动

为保证干涉仪程差在Q点小振动完全 由调制信号决定,在伺服环路里设置了以调 制信号频率fm为中心带的阻滤波器,使伺服 环路在调制信号fm处没有环路增益,失去伺 服作用,而对其它频率则有负反馈抑制功能。

#### 2.3. 小位移(小振动振幅)定标

设 $\phi_1 - \phi_2 = \phi_0 + \phi_m$ ,式中 $\phi_0$ 是两臂初 始位相差, $\phi_m$ 是加调制信号所引起的相位 差。且有

 $\phi_0 = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$  (n=0, ±1, ±2, …) (2) 设镜子位移  $x(t) = x_0 \sin 2\pi f_m t$ , 这样

$$\phi_m = \frac{2\pi}{\lambda} 2x(t) = \frac{4\pi}{\lambda} x_0 \sin 2\pi f_m t, \quad (3)$$

将 φ<sub>1</sub>-φ<sub>2</sub> 值代入光强公式(1),并利用 x<sub>0</sub>≪ λ,得到了光电接收器之输出电压;

$$V(t) = V_0 \Big[ 1 + \frac{4\pi}{\lambda} \gamma x_0 \sin 2\pi f_m t \Big] + V_0 \Big[ 1 + \frac{4\pi}{\lambda} \gamma x_0 \sin 2\pi f_m t \Big]$$

$$\times \cos 2\pi f_0 t \qquad (4)$$

式中 Vo为工作点直流电平,其拍频项包含 要检测的小位移信息。 经锁相放大器振

· 157 ·

幅解调后可得到以 $f_m$ 为频率的正弦信号  $\left(K \cdot \frac{4\pi}{\lambda} V_0 \gamma x_0 \sin 2\pi f_m t\right)$ ,其中K是锁相放 大器使用的增益。设上述信号的振幅 $\left(K \frac{4\pi}{\lambda} V_0 \gamma x_0\right)$ 的可分辨极限值为 $V_{\min}$ ,则有

$$x_{0\min} = \frac{\lambda V_{\min}}{4\pi V_0 \gamma K}$$
 (5)

由(5)即可标定小位移检测极限。

## 三、实验结果

图1中,高压源和调制信号 fm 加在镜片 M1的压电陶瓷上,高压偏压用来调整工作 点。镜片 M2的压电陶瓷是调程长元件。锁相 放大器的参考信号是拍频信号 foo。实验表明, 干涉仪程长锁定后,光程的低频抖动减少了 10<sup>-3</sup> 量级,如无特大震动,工作点可长期保持 不变。



图 3 示波器照片 上面的波形是加在检测镜 M<sub>1</sub>的驱动信号,相应 的下面波形是锁相放大器的输出信号(图(a) 500mV/div,图(b)、(c)50mV/div)

本实验所用调制信号 fm=3.3kHz,图 3中(a)和(b)、(c)分别为伺服回路开环和闭 环时的检测结果,照片(c)为驱动信号较大时 的情况,照片(b)为电信号减小到一定程度时 的情形。照片(b)中锁相放大器的输出波形曲 线变粗,说明其中已有明显的噪声成分。若 再减小驱动信号,可以看到锁相放大器输出 信号中噪声成分显著增加,波形畸变,最后信 号完全被噪声淹没。所以照片(b)是接近极限 检测的情况。可以认为锁相放大器输出波形的振幅可分辨极限值 $V_{min}=10 \text{ mV}$ ,其它实验数据为:  $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ , $V_0 = 0.75 \text{ V}$ ,  $\gamma = 0.99$ ,K = 140。利用公式(5)得到:

$$v_{0\min} = \frac{\lambda V_{\min}}{4\pi V_0 \gamma K} = 0.005 \,\mathrm{nm},$$

而在伺服回路开环时,由(a)图可判断 Vmin 为 200mV,检测最小振幅值为0.1nm,由此可 见采取稳光程措施后明显地提高了检测分 辨率。

#### 四、讨论

#### 4.1 关于噪声抑制问题

小位移检测的分辨率取决于对噪声的抑制程度,噪声中主要成分是环境噪声(空气流、声波、机械振动等引起光程差无规抖动),除此之外,尚有激光源的噪声(功率及频率的抖动)、光探测器电子线路的噪声及散粒噪声等。本实验使用的稳频激光器短期频率稳定度为10<sup>-11</sup>量级,对实验精度的影响可忽略,且在目前检测精度下,实验中未发现激光功率抖动的影响。因此抑制噪声主要针对环境噪声及光探测器电路噪声。

有的文献认为,采用拍频检测技术避开 了低频噪声源(包括低频的 1/f 噪声和环境 噪声)。实际上环境低频噪声源的干扰使干 涉仪光程差无规抖动,这种无规抖动和有规 的调制信号作用一起都被拍频信号载上了, 因此要检测的低频信号和环境噪声混在一 起,所以拍频技术对噪声的隔离作用并非对 所有的低频噪声源有效,应该说主要是避开 了光探测器的低频噪声。本实验的载频 fo= 200kHz,低频 kHz的位移信号被载频移到较 高频段处理,对克服光探测器低频噪声无疑 会有好处。因此为克服环境噪声,本方案采用 了稳定光程技术,拍频检测和稳光程两者结 合起来,起到了更好的抑制噪声作用。

(下转第169页)

### 三、实验结果

我们采用一3×3×50mm<sup>3</sup>的CdTe电光晶体 在一放电长度为 60 cm 的外腔式 CO2 激光器上进行 了外腔耦合电光调制实验,对以上分析进行了实验 验证。实验装置如图3所示。分束片 \$1、合束片 \$3, 及布氏窗片 \$2 均为 ZnSe 片。 R1 和 R2 为镀金全反 射平面镜。电光晶体驱动电源为一2W的高频功率 信号源,有时也采用50Hz市电低频交流信号。光 电探测器为一响应频率>200 MHz的HgCdTe探 测器。解调信号经一带宽>300 MHz 的低噪声放大 器(增益约50dB)放大后,显示在一台100MHz示 波器上,为了实现外差探测,从激光器输出的光束在 21 被分为两束,本振光经过一可移开的挡光板后在3 与被调制信号光合为一束。经细致调整两束光的平 行度并使之完全重叠入射到探测器上,则可得到外 差探测。当挡光板挡住本振光而只有信号光入射到 探测器上时,则得到直接探测。对于比较加不同直 流偏压时,外差和直接探测的解调波形非常方便。

图 4 中给出了几张实验拍摄的外腔电光调制的 典型解调波形。输入调制信号峰值 100 V。在零直



(上接第158页)

## 4.2. 测量精度分析

由于激光束的反馈会使稳频塞曼激光器 工作不正常,甚至失锁。为避免发生这种情况,在干涉仪光路调节时,有意使入射激光束 稍稍偏离正入射方向(相对反射镜片)θ角 度,我们将讨论这种偏离带来的影响,同时也 讨论一下工作点抖动引起的误差。

设偏离正入射方向为 $\theta$ 角,(3)式应改 为:  $\phi_m = \frac{2\pi}{\lambda} 2\cos\theta x(t)$ 。

若工作点抖动引起相位偏差为 4年, (2)式应

流偏压点,采用外差探测得到与输入信号频率一致 的不失真解调,而采用直接探测则只能得到两倍频 率的失真解调(即上翻失真达到最大)。如果加大直 流偏压,则上翻失真减小,继续加大偏压,则可完全 消除上翻失真,得到不失真的解调。图4(d)中上翻 成为下凹,是由于 HgCdTe 探测器输入与输出反相 的缘故。图4表明理论分析和实验现象吻合较好。 在另一些直流偏压点,我们也拍摄了类似的解调 波 形,得到了与理论相一致的结果。



#### 图 4 外腔电光调制分别采用外差探测和 直接探测时的解调波形比较

 (a) 调制输入信号, V<sub>m</sub>=100 V;
 (b) 外差探测信号, V<sub>0</sub>=0, 不失真;
 (c) 直接探测信号, V<sub>0</sub>=0, 倍频失真;
 (d) 直接探测信号 V<sub>0</sub>=50 V, 畸变(e) 外差或 直接探测信号 V<sub>0</sub>=V<sub>m</sub>/2=1600 V, 倍频失真

(收稿日期: 1987年9月14日)

改为 $\phi_0 = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2} + 4\phi_0$ 考虑上述修正后, (5)式改为:

$$x_{\rm 0min} = \frac{\lambda V_{\rm min}}{4\pi V_0 \gamma K \cos \Delta \phi \cos \theta} \tag{6}$$

实验中调节 $θ\approx0.5^{\circ}$ ,引起的偏差为 $4\times10^{-5}$ , 因此可以忽略。工作点锁定后,相位偏离 $4\phi$ 约为 $1^{\circ}$ ,引起的误差为 $1.5\times10^{-4}$ ,也可忽 略。而伺服环路开环时,工作点抖动引起的  $4\phi>50^{\circ}$ ,误差大于 $50^{\circ}$ ,所以锁定干涉仪 后,测量准确度大大提高。

#### 参考文献

1 Ohtsuka et al., Appl. Opt., 18(2), 219(1979)

2 汤俊雄 et al., 中国激光, 待发表